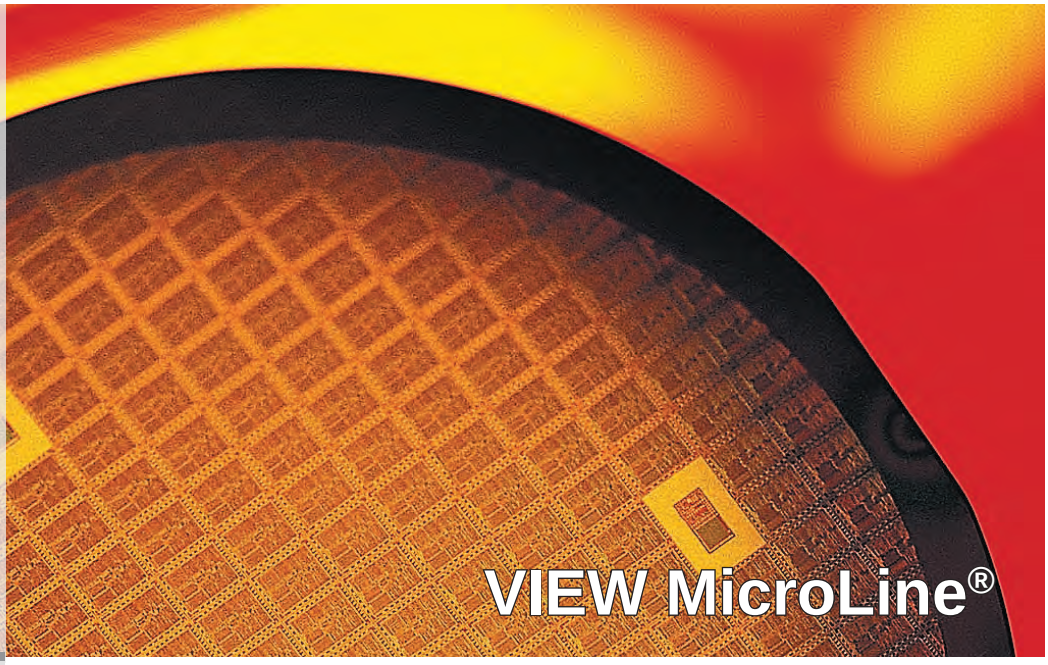

VIEW MicroLine®

Automatisiertes Messsystem für kritische Dimensionen

VIEW MicroLine Hochleistungs-Messsysteme für kritische Dimensionen mit hohen Anforderungen an die Genauigkeit ermöglichen die Messung von Wafern, Masken, MEMS und anderen kleinsten Merkmalen. Diese leistungsfähigen Tischsysteme bieten eine präzise, automatisierte Messung von Merkmalen von nur 0.5 µm an Bauteilen bis 300 x 300 mm.

- Mikroskop-Optik mit 5 Positionen-Objektivrevolver und DIC-Schlitz
- Intelligenter Autofokus für optimale Bildqualität
- Durchlässige und reflektierende Beleuchtungsmittel mit programmierbarer Quelle und Intensität
- Stabile Messungen transparenten Ebenen, Linien mit rauhen Kanten und vieles mehr

Modell	X	Y	Z
1000	100 mm	100 mm	175 mm
2000	200 mm	200 mm	175 mm
3000	300 mm	300 mm	145 mm

Abb: VIEW MicroLine 1000

VIEW MicroLine®

Messsoftware:

- VIEW Mess-Software (VMS)

Optionale Software-Module:

- Advanced Image Processing
- COM and Custom UI
- MeasureFit® Plus
- SmartProfile® GD&T-Auswertung
- VMS Offline image processing workstation

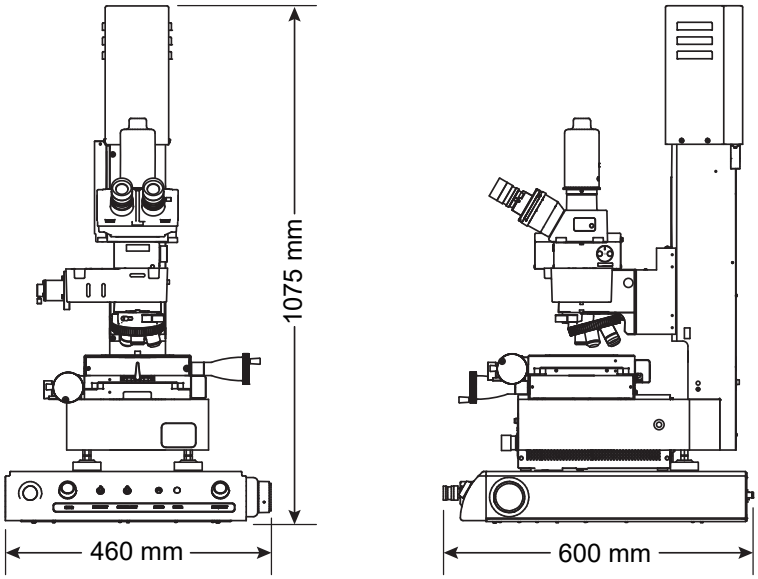

Abb: VIEW MicroLine 1000

XYZ-Verfahrweg (mm)	**MicroLine 1000** 100 x 100 x 175	**MicroLine 2000** 200 x 200 x 175	**MicroLine 3000** 300 x 300 x 145
Werkstückgewicht (Max.)	6 kg	10 kg	15 kg
Maschinengewicht	Unverpackt: 105 kg; Verpackt: 180 kg	Unverpackt: 165 kg; Verpackt: 280 kg	Unverpackt: 290 kg; Verpackt: 440 kg
	Standard	**Optional**	
XY - Tisch	Kreuztisch mit manueller Positionierung und Schnellverstellung. X,Y, Z-Massstäbe zur Positionsreferenzierung. Glaseinsatz zur Verwendung mit Durchlicht		
Z Achse	Motorisierte Z-Achse mit Drehtischsteuerung und programmierbarem Autofokus		
XYZ-Massstabsauflösung	0.1 µm		
Optik	Mikroskop-Optik-System mit manuellem Objektivrevolver und 5 Positionen , Hellfeld / Dunkelfeld-Beleuchtung und trinokularem Betrachtungssystem mit optischem Fadenkreuz	Analysatoren, Polarisatoren und DIC (Defferentieller Interferenzkontrast)	
Tubus	0.63X Tubus	Andere Optionen auf Anfrage erhältlich	
Objektive	10X Hellfeld / Dunkelfeld 50X Hellfeld / Dunkelfeld	5X Hellfeld / Dunkelfeld 20X Hoher Arbeitsabstand, Hellfeld / Dunkelfeld 100X Hoher Arbeitsabstand, Hellfeld / Dunkelfeld 150X Hellfeld / Dunkelfeld	
Kamera	Hochauflösende digitale S/W-Kamera	Unterschiedliche Kamerakonfigurationen auf Anfrage erhältlich	
Beleuchtung	Programmierbares grünes LED-Auflicht and LED-Durchlicht	Weißes LED-Auflicht und Farbfilter	
Controller	Auf MS Windows®-Basis, mit modernstem Prozessor sowie Onboard-Ports für Netzwerk und Kommunikation	Ein oder zwei 24" LCD-Flachbildschirme, Tastatur, 3-Tasten-Maus (oder vom Benutzer selbst beigestellt)	
Mess-Software	VIEW Mess-Software (VMS)	VMS Offline-Messsoftware	
Elektrischer Anschluss	100 - 120 VAC oder 200 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1 Phase, 250 W		
Umgebungsspezifikationen	Temperatur 20 °C, stabil bis ±1 °C / Stunde, 30-80% relative Luftfeuchtigkeit; max. Bodenschwingung <0.001g unter 15 Hz		
Bildfeldgenauigkeit	0.070 µm rückführbar zu NIST		
Bildfeld-Reproduzierbarkeit	0.010 µm (1σ) auf Wafern (mit 100X oder 150X Objektiven)		

Phone: (480) 295-3150 • (877) 767-VIEW (8439)
Fax: (480) 889-9059
info@viewmm.com
www.qvii.com/VIEW

©2020 Quality Vision International Inc. Specifications subject to change without notice. All rights reserved. Trademarks are the properties of their respective owners.
Export of this product is controlled under U.S. Export Regulations. An Export License may be required for deliveries or re-export outside the United States. Part Number 791005-0419